PAT-NO:

JP401073239A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01073239 A

TITLE:

GAS CONCENTRATION MEASUREMENT FOR LASER TYPE

GAS SENSOR

PUBN-DATE:

March 17, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME SAWADA, AKIRA DOI, SHOJI SUGIYAMA, IWAO ISHIZAKI, HIROYUKI SHINOHARA, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP62230251

APPL-DATE:

September 14, 1987

INT-CL (IPC): G01N021/39

US-CL-CURRENT: **250/339.13**

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable accurate measurement of the concentration of a gas to be

measured as desired, by measuring spectra separately beforehand for a wavelength area of overlapping spectra to calculate a matrix of correction

factors, which is multiplied by a matrix of actually measured values.

CONSTITUTION: A laser light from a laser light source 15 is transmitted

through a gas 16 to be measured to be incident on a photo detector 17 and

converted into an electrical signal to undergo a density measurement processing

for a gas being measured. A calculation means 18 determines a ratio between a

known density of gas and a signal level in (n) wavelength areas where spectra

of (n) types of gases overlap one another separately obtained by spectral

measurement of the (n) different types of gas in terms of a known density of

gas in the form of a matrix of (n) lines × (n) columns and an inverse

matrix thereof is calculated to determine correction factors separately, which

are stored with a memory means 19 beforehand. A calculation means 20 performs

multiplication between a spectral measured value matrix based on the laser

light transmitted through an atmosphere where more than one of the (n) types of

gas are mixed and a matrix stored in the memory means 19.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

8/18/2005, EAST Version: 2.0.1.4

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-73239

Solnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和64年(1989) 3月17日

G 01 N 21/39

7458-2G

未請求 発明の数 1 (全7頁) 審査請求

49発明の名称

⑫発 明

②発

明

レーザ方式ガスセンサにおけるガス濃度測定方法

②特 昭62-230251

亮

⑫出 願 昭62(1987)9月14日

砂発 明 者 田 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

者

者

巖

正

内 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 之 洋 石 崎

土

杉

肥

山

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

外1名

富士通株式会社 ①出 願 人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

明 細 冉

1. 発明の名称

レーザ方式ガスセンサにおけるガス濃度測定 方法

2. 特許請求の範囲

半導体レーザ光源(15)より放射されたレー ザ光を、被測定ガス雰囲気(16)中に透過させ、 その透過光の光強度を光検知器(17)により電 気信号に変換し、更にその電気信号に基づいて該 被耕定ガスの濃度を検出するレーザ方式ガスセン サにおいて、

互いに異なる「種類のガスを別々に予め収加の ガス湿度で夫々スペクトル測定して投た、該n橈 類のガスのスペクトルが互いに重なる各り個所の 波長領域における信号レベルと前記以知のガス頭 度との比をD打D別の行列の形で求め、その逆行 別を計算して夫々組正係数を求める第1の貸出手 及(18)と、

該第1の算出手段(18)により算出された全 部で n 2 個の 額正係数を n 行 n 列の行列の形で予 め記憶する記憶手段(19)と、

少なくとも 抜 D 種類のガスのうち 2 種類以上の ガスが混在している雰囲気中を透過した前記レー ザ光から前記光検知器(17)により将た電気信 身の笛の行列と該記憶手段(19)から読み出し た該行列とを乗算して、上記2種類以上のガスが 混在している雰囲気中の被測定ガスの激度を算出 する第2の負出手段(20)とよりなることを特 傲 とするレー ザ方式 ガスセンサにおけるガス 遺皮 魏定方法。

3. 発明の詳細な説明

(段 夏)

半導体レーザ光を用いてガスの遺食や種類を検 知するレーザ方式ガスセンサにおいてガス温度測 定方法に関し、

被選定ガスのスペクトルに妨害ガスのスペクト

ルの母なりがある場合でも、妨害ガスの影響を受けることなく正確に被測定ガスの過度を測定することを目的とし、

半導体レーザ光源より放射されたレーザ光を、 被測定ガス雰囲気中に透過させ、その透過光の光 強度を光検知器により電気信息に変換し、更にそ の徴気信号に基づいて該被測定ガスの濃度を検出 するレーザ方式ガスセンサにおいて、互いに異な る n 種 類 の ガ ス を 別 々 に 予 め 民 知 の ガ ス 弱 度 で 夫 々スペクトル測定して得た、該 n 種類のガスのス ペクトルが互いに重なる各n個所の波長領域にお ける信号レベルと前記瓜知のガス濃度との比をn 行n刃の行刃の形で求め、その逆行刃を計算して 夫々補正係数を求める第1の算出手段と、該第1 "の弊出手段により算出された全部でn~ 個の補正 係数をn行n列の行列の形で予め記憶する記憶手 段と、少なくとも該n種類のガスのうち2種類以 上のガスが混在している雰囲気中を透過した前記 レーザ光から前紀光検知器により得た電気信号の 篁の行列と該記憶手段から読み出した該行列とを

(産業上の利用分野)

出手段とより楈成する。

本発明はレーザ方式ガスセンサにおけるガス設度測定方法に係り、特に半導体レーザ光を用いてガスの遺底や種類を検知するレーザ方式ガスセンサにおけるガス遺産測定方法に関する。

乗貸して、上記 2 種類以上のガスが混在している

雰囲気中の放剤定ガスの遺皮を貸出する第2の貸

レーザ方式ガスセンサは一般に第5図に示す如き構成とされている。同図中、半導体レーザ光線 1から放射されたレーザ光は、レンズ2により集 光されてからハーフミラー3に入射され、ここで 光路を2分岐され、一方はミラー4で全反射され て多照セル5に入射され、他方はレンズ6を返過 して凹面鏡7a~7cからなる多距反射セル8に 入射される。

参照セル5内には種類、温度が既知の参照ガス が充調されており、この参照ガスを透過したレー ザ光は特定の波長で減衰を受けた後、レンズ9を

通して光検知器10で受光され、ここで光宿変換される。

一方、多重反射セル8は被測定ガス雰囲気中に配置されており、被測定ガス雰囲気中の光路を長くしてガス検出感度を高くするため、レーザ光を多重反射セル8内において多重反射する。多重反射セル8によって光路が長くされ、かつ、被測定ガス固有の波長帯において減衰を受けたレーザ光は、レンズ11を軽て光検知器12で受光され、ここで光電変換される。

光検知器10及び12より夫々取り出された電 気信号は信号処理装置13に供給され、ここで両 者を比較することによってガス濃度を算出する。

このような構成のレーザ方式ガスセンサにおいては、被測定ガス以外に、スペクトルが重なる他のガスが確在していても、正確に被測定ガスの満度だけを分離測定することが重要となる。

(従来の技術)

従来のレーザ方式ガスセンサにおいては、信号

処理装置13が2次数分計測法により、被測定ガスのスペクトルを、それ以外のガス(妨害ガス)のスペクトルから分離し、きわだたせている。

すなわち、前記被測定ガス雰囲気中を透過した レーザ光(透過光)の光強度は第6図に示す如く、 ガスによる吸収により実験で示すように特定として はおいて d だけ減衰する。ここで、計測をより質 にするため、第6図に示す如く半導体レーザ 光原にするため、第6図に示す如く半導体レーザ 光原1からのレーザ光の波長をaで示す如く吸収 期検波してかられる信号量がガス遺疫に比例する ことを利用してガス遺疫を計測する。この方法は 数分計測法と呼ばれる。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、妨害ガスの遺収が大きい場合、スペクトル吸収係及が大きい場合、あるいは被謝定ガスのスペクトル吸収袋が妨害ガスのスペクトル吸収額に接近している場合は、従来の微分計期法によっては完全に分離できず、正確なガス遺皮測定が

できなかった。

また、大気中の水茂気の影響、すなわち、セル 外光路の水焼気のスペクトルが、被割定ガスのス ペクトルに重なる場合、正確な濃度割定ができな いという問題点があった。

本発明は上記の点に鑑みて創作されたもので、 被酬定ガスのスペクトルに妨害ガスのスペクトル の重なりがある場合でも、妨害ガスの影響を受け

関定して打た、n種類のガスのスペクトルが互いに重なる各n個所の被長領域における信号レベルと以知のガス濃度との比をn行n列の行列の形で求め、その逆行列を計算して夫々補正係数を求める。

記憶手段19は上記の全部でn2 個ある補正係数をn行n列の行列の形で予め記憶する。

第2の算出手段20は前記 n種類のガスのうち 2種類以上のガスが混在している雰囲気中を透過 したレーザ光に基づくスペクトル類定値列と記憶 手段19に記憶した行列との乗算を行なう。

(作用)。

説明の簡単のためn=2の場合について説明するに、第1の種類のガスだけのスペクトルは遺度 C = (%)のとき第2図(A)に示す如くになり、第2の種類のガスだけのスペクトルは遺度 C = (%)のとき同図(B)に示す如くなるものとし、また、これらのスペクトルが互いに重なる2個所の領域①、②のうち領域①における上記2種類の

ることなく正確に被認定ガスの設度を認定することができるレーザ方式ガスセンサにおけるガス設 度測定方法を提供することを目的とする。

(周頭点を解決するための手段)

第1図は本発明の原理構成図を示す。半導体レーザ光額15より放射されたレーザ光は被測定ガス雰囲気16中を透過して光検知器17に入射され、ここで電気信号に変換された後被測定ガスの 変度制定処理を受ける。

本発明はこのようなレーザ方式ガスセンサにおいて、第1の算出手段18、記憶手段19及び第 2の算出手段20よりなるものである。

第1の貸出手段18は実際の測定に先立ち予め 設けられており、第2の貸出手段20と記憶手段 19が実際の類定時に用いられる。ただし、記憶 手段19への行列の記憶は実際の測定に先立ち予め行なわれている。

第1の作出手段18は互いに異なるn 種類のガスを別々に予め成知のガス濃度で夫々スペクトル

ガスの検知信号レベルをSi.Ni、領域のにおける検知信号レベルをNi.Siとすると、第1の算出手及18は

$$a_{11} = S_{1} / C_{1}$$
, $a_{21} = N_{1} / C_{2}$
 $a_{22} = S_{2} / C_{2}$, $a_{12} = N_{2} / C_{1}$

なる式で示される袖正係数 a_1 . a_{21} . a_{22} 及び a_1 を夫々算出する。なお、 N_1 と N_2 は負になることもある。

その後an , a 21 , a 2 及びa 2 に対して

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = A^{-1}$$
 (2)

なる2行2列の逆行列を計算する。

配位手段19は計算結果の行列を配位する。

次に実際の選定時に前記第1のガスの讃良が X - (%)、前記第2のガスがX - (%)で混在 しているガス雰囲気中を透過したレーザ光を光程 変換して得た借号に基づいて得られる、領域①に おける第1のガスのスペクトルの大きさ Y - は、

同様にして、実際に領域②で排定される第2の ガスのスペクトルの大きさY』は

従って、
$$(3)$$
式及び (4) 式より
$$\begin{pmatrix}
Y_1 \\
Y_2
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
a_1 & a_{21} \\
a_{12} & a_{22}
\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}
X_1 \\
X_2
\end{pmatrix}$$
(5)
となるから、②式を用いて上式を整理すると
$$\begin{pmatrix}
X_1 \\
X_1
\end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix}
Y_1 \\
Y_2
\end{pmatrix}$$
なる式が成立する。

そこで、第2の貸出手段20は、記憶手段19から読み出したAの逆行列A。と、光検知器17よりの信号に基づいて特たスペトクルの値の行列(Y・ Y・) 「(ただし、Tは転置を示す)とを乗算することにより、60式からわかるようにより、60式からわかるように、2種類のガスが混在しているガス雰囲気中の被称定ガスの濃度X・又はX・だけを正確に算出することができる。

以上はガスの種類が2種類の場合であったが、

なる乗弊を行なうことにより、 n 種類のガスの各 適度 X i ~ X n を求めることができ、その中から 任意の被測定ガスの遵度だけを得ることができる。

(実施例)

レーザ方式ガスセンサのうち大気中の二酸化硫 黄(SOェ)ガスの濃度を測定する環境用SOェ ガスセンサにおいては、大気中の水液気(HzO) の影響が問題となる。

第3図は激度10ppm、セル長10mで測定したSO2ガスの2次位分スペクトルを示す。また、第4図は遺度 2.0×10゚ppm、セル長10mで測定した大気中の水蒸気の2次数分スペクトルを示す。

SO』ガスの2次数分スペクトル図中、他のガスとの区別が比較的つけ易く、また信号レベルが比較的大となる1370.3cm 「付近の特定被数の領域を領域①とする。同様に、第4図の水蒸気の2次数分スペクトル図中、他のガスとの区別がつけ易い1371.5cm 「付近の特定波数の領域を領域②とす

同様にして第1の野出手段18により n 種類(ただし、n は2以上の熱数)のガスに対してa m ~ a n n を貸出した後、次式のn 行n 列の逆行列 B →

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \cdots & a_{n-1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{22} & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1-n} & a_{2-n} & a_{3-n} & \cdots & a_{n-n} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{2n} & a_{2n} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & a_{n-n} \end{bmatrix}$$

を求めて記憶装置19にB↑を記憶させておき、 実際の測定時に第2の算出手段20により実調値 Yi~Ynによりなるn行・1列の行列と上記逆行 列B↑との間で

$$\begin{pmatrix}
X_1 \\
X_2 \\
X_3 \\
\vdots \\
X_n
\end{pmatrix} = B^{-1} \cdot \begin{pmatrix}
Y_1 \\
Y_2 \\
Y_1 \\
\vdots \\
Y_R
\end{pmatrix}$$
(8)

a.

第3回において、領域①における信号但Siは 0.014であり、領域②における信号母Niは 0.001であり、またガス濃度Ciは1Oppmである。従って、前記(1)式よりan = 0.0014, an = 0.0001 となる。

なお、信号量の測定は、その領域の信号レベルのピークの点(例えば第3図にaで示す)の両側の数分係数がゼロとなる2つの点(第3図に b. Cで示す)を結んだ線分上の特定波数の点(第3図に d で示す)と上記ピーク点との差により求められる。

一方、第4図において、領域①における信号版 N_1 は 0.002であり、領域②における信号 0.002であり、またガス遺版 0.013であり、またガス遺版 0.013であり、またガス遺版 0.013である。従って、前記(1)式より 0.011 0.001 0

特開昭64-73239(5)

格納されている。

このROMを始えた環境用SOz ガスセンサにより被酬定SOz ガスの遺底を測定する手順について次に説明する。

まず、赤外レーザ光の被長を領域①で掲引して 大気中に存在するSO2 ガスと水流気との混合ガスのスペクトルの山の高さ(2次微分信号レベル)・ Y:を測定する。

次に赤外レーザ光の波長を領域②で掲引して大気中に存在するSOェガスと水放気との混合ガスのスペクトルの山の育さ(2次微分信号レベル) Yュを求める。

そして、環後に上記ROMに記憶されている2 行2列の行列を読み出し、その行列と上記の訓定 位 Y 」、Y 』による2行1列の行列との乗算を行 なうことにより真のSO』ガスの濃度 X 』と水蒸 気温度 X 』とを夫々算出することができる。

なお、化学プラント等、測定対象となる気体中に含まれるガス種が多く、しかも似たガス種 (NH:,NO.OHなど同じ官能基をもつ場合) のときには、スペクトルの重なりが多い。

このような3種以上のガス種についても、お互いに重なり合うスペクトルの波及領域について予め別々にスペクトルを測定して補正係数の行列を類出し、それを予めROMに記憶しておき、実際の研定時にその行列を読み出して実剤値の行列との乗算を行なうことにより、同様にして真のガス剤度を貸出することができる。

(発明の効果)

上述の如く、本発明によれば、互いにスペクトルの銀なる被疑はがn個所あるn種類のガスが超れてするガス雰囲気中から、所望の被測定ガス遊費ではを正確に測定することができ、よって大気中の水茂気を200万名との所望の被測定ガスのの複印を到定することができる等の特長を有するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は木発明の原型構成図、

第2図は本発明の測定原型説明図、

第3回はSO2ガスの2次微分スペクトルを示す図、

第4回は大気中の水流気の2次微分スペクトルを示す図、

第5回はレーザ方式ガスセンサの一例の構成図、 第6回はレーザ被長と透過光強度との関係を示 す図、

第7図は測定されるスペクトルの説明図である。

図において、

15は半導体レーザ光源、

16は被測定ガス雰囲気、

17は光検知器、

18は第1の算出手段、

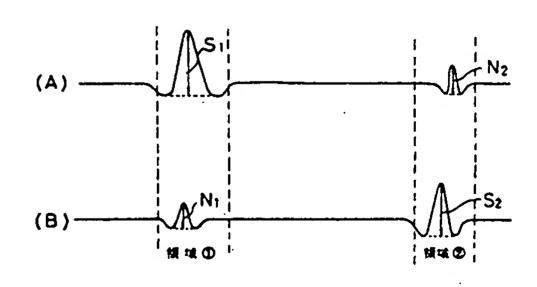
19は記憶手段、

を示す。

20は第2の算出手段

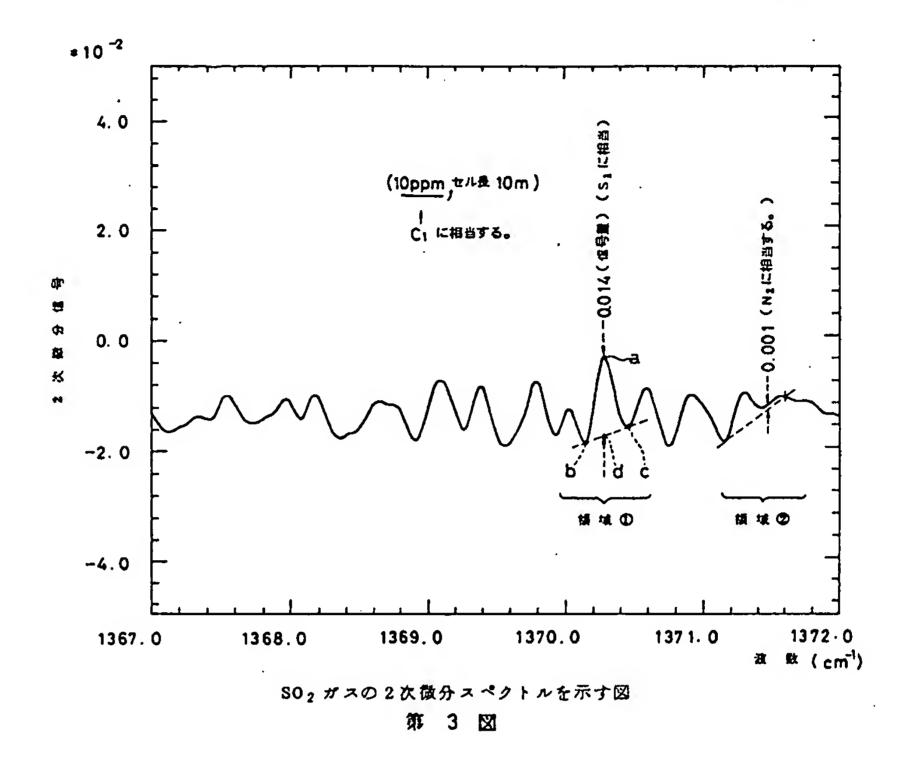
| 18 | 第 1 の | 第 1 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の | 第 2 の

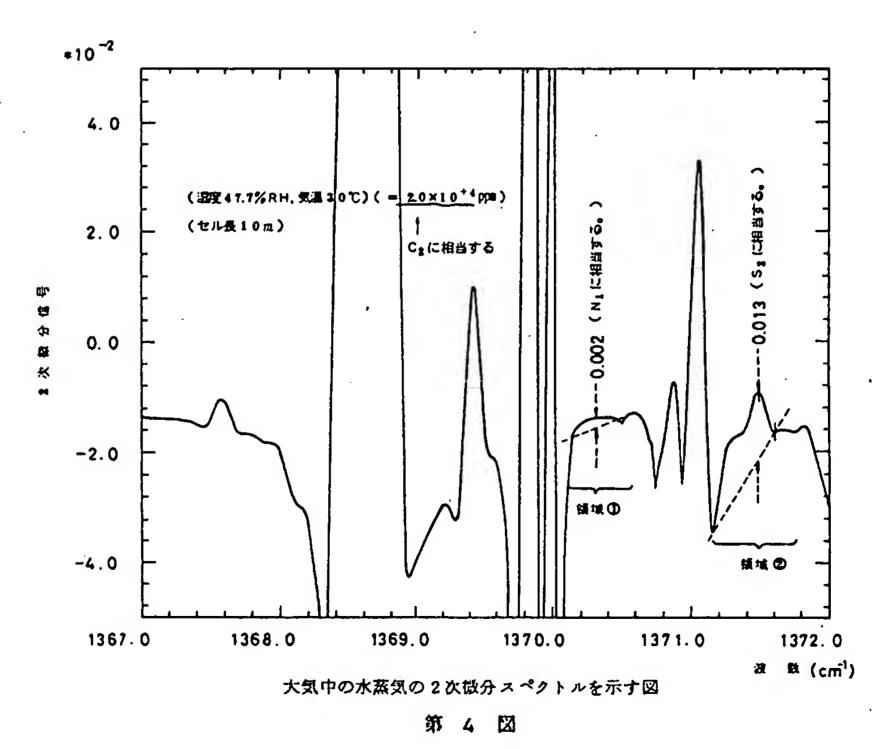
本発明の原理構成図 第 1 図



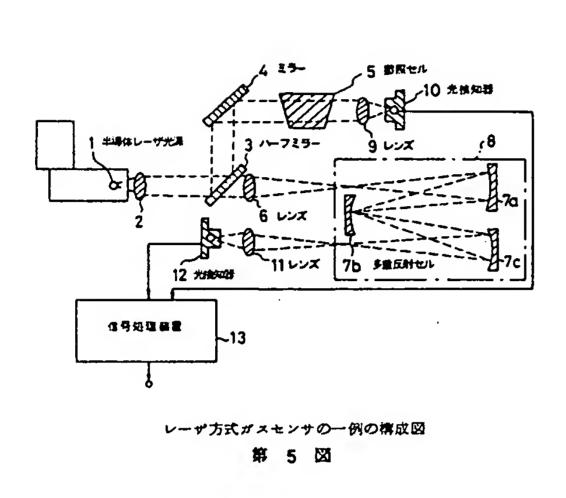
本発明の測定原理説明図

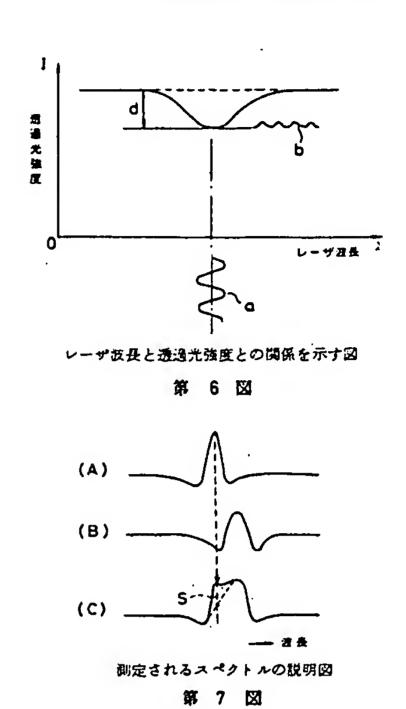
第 2 図





-222-





第1頁の続き ②発明者 篠原 宏爾 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.